



精密研磨装置

MAシリーズ

試料研磨に再現性を

サンプルに適した試料ホルダーを選定することで
多様な形状・加工目的の研磨加工を行えます。

また、研磨盤や研磨剤を置き換えることで
粗研磨から鏡面仕上げ、CMP(化学的機械研磨)
まで1台で対応可能です。

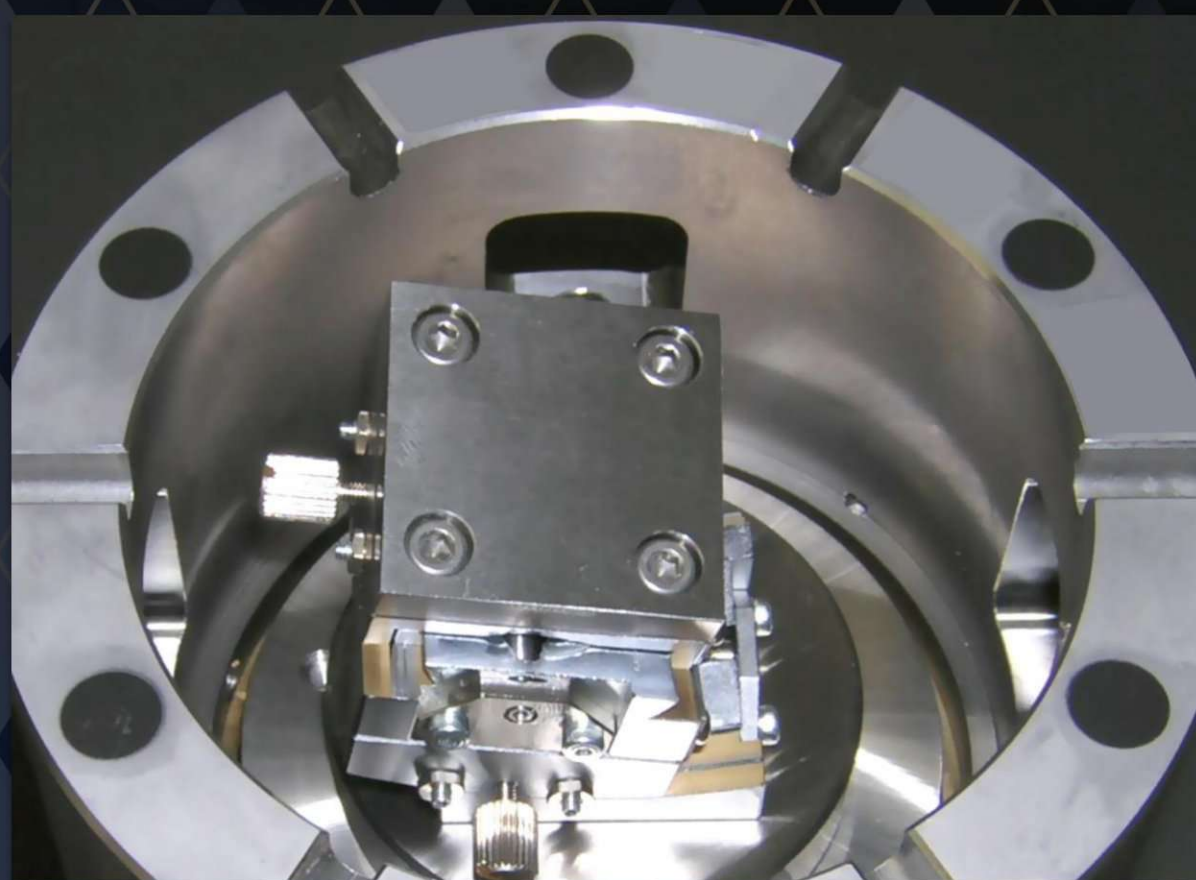
●加工実績のある材料例

- ・半導体材料：Si/ SiC/ GaN/ GaAs/ InP/ Ga2O3 …
- ・光学材料：ガラス/ サファイア/ CLBO/ YIG/ GGG …
- ・セラミックス材料：アルミナ/ 窒化ケイ素 …

その他、金属材料や鉱物、生体試料など
多数の実績がございます。



様々なサンプルに対応



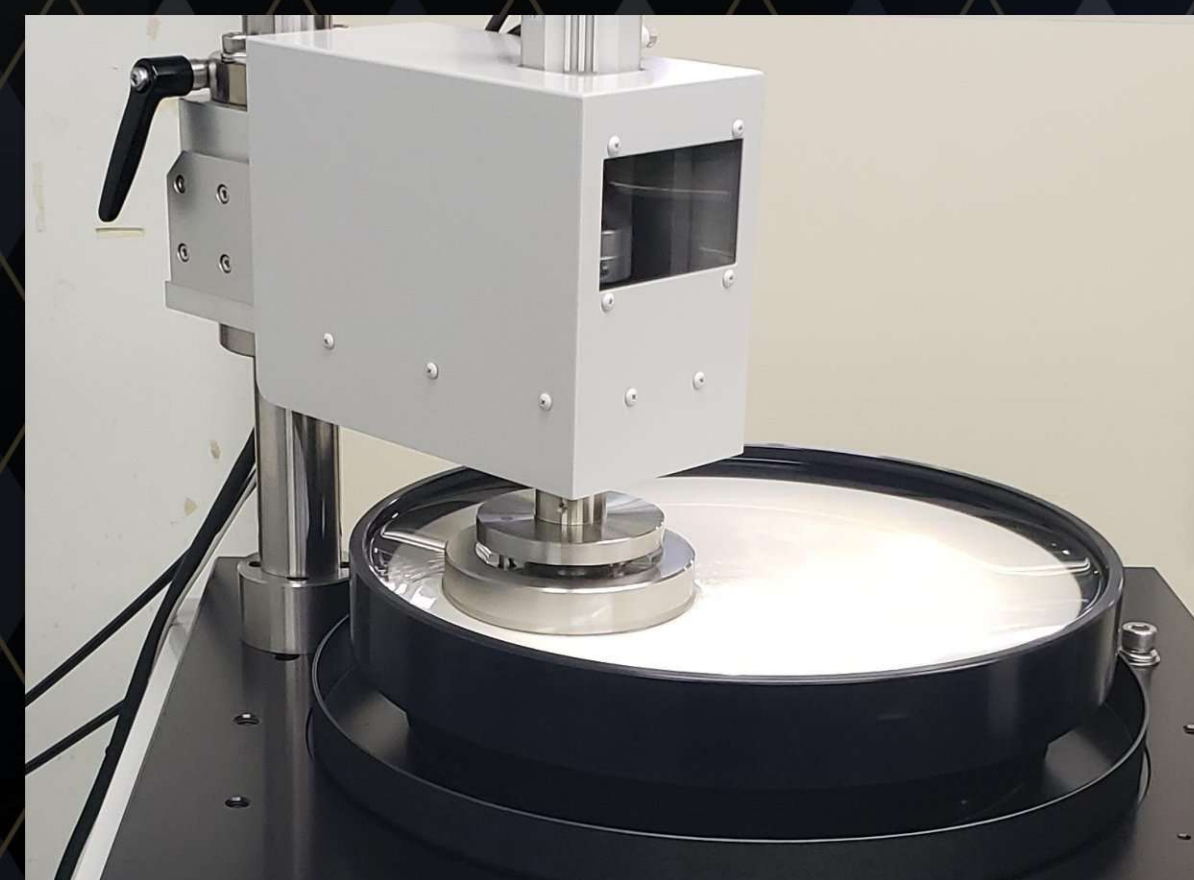
ウェハー平坦化や板材の端面研磨、
樹脂包埋サンプルの研磨など多様な
用途に対応した試料ホルダーを
ご提案いたします。
特注製品の設計も承っております。

研磨除去量の制御



精密研磨用の試料ホルダーを用い
ることで1μm単位で研磨除去量を
設定することが可能です。
材料によっては加工面平行度も
3μm以内に収めることが可能です。

粗研磨からCMPまで



研磨盤や研磨剤などの研磨用品を
置き換えることによって、
粗研磨工程から鏡面仕上げ、
CMP(化学的機械研磨)工程までを
1台の装置で行えます。

型式	MA-150
電源	AC100V 1A
モーター	40W
研磨盤	Φ150mm
回転数	0～180rpm
操作盤	アナログ
サンプル	～Φ50mm

型式	MA-200e
電源	AC100V 5A
モーター	120W
研磨盤	Φ200mm
回転数	10～200rpm
操作盤	デジタル
サンプル	～Φ100mm

型式	MA-300e
電源	AC100V 10A
モーター	200W
研磨盤	Φ300mm
回転数	10～200rpm
操作盤	デジタル
サンプル	～Φ150mm

型式	MA-400e
電源	AC200V 15A
モーター	400W
研磨盤	Φ400mm
回転数	10～200rpm
操作盤	デジタル
サンプル	～Φ200mm